

Niskociśnieniowy system plazmowy V15 – G

Standardowy system do czyszczenia, aktywacji i trawienia

System jest zintegrowany w 19-calowej szafie rack, która jest wyposażona w rolki i nóżki o regulowanej wysokości.

Profesjonalna jednostka sterująca PLC służy do przechowywania definiowalnych parametrów procesu.

Cechy systemu

- Port USB
- Interfejs Ethernet
- Zdalna konserwacja (VPN)
- Złącze mikrofalowe od góry
- Drzwi wahadłowe

Opcje

- Pompa próżniowa
- Pułapka ozonowa
- O trzech dodatkowych wlotów gazu
- Dodatkowe częstotliwości wzbudzenia (40 kHz, 13,56 MHz)
- Bęben obrotowy do obróbki materiałów sypkich
- Stół obrotowy
- Boczne sprzężenie mikrofalowe
- Miękki start i powolne odpowietrzanie



Widok do komory procesowej

Dane techniczne

Wymiary systemu (szer. x gł. x wys.): 670 x 900 x 1,850 mm

Wymiary komory (szer. x gł. x wys.): 250 x 250 x 250 mm

Częstotliwość wzbudzenia plazmy: Mikrofałe (2.45 GHz)

Moc mikrofał: 100-600 W

Wloty gazu z regulacją przepływu masowego: 1

Zasilanie: 230/400 V, 50 / 60 Hz

Pobór mocy: 1.5 kVA

Wakuometr: Pirani



PiNK GmbH
Thermosysteme

Am Kessler 6
97877 Wertheim

Germany

T +49 (0) 93 42 919 - 0

F +49 (0) 93 42 919 - 111

plasma - finish@pink.de

www.pink.de

Standardowy system V15-G przeznaczony jest do przemysłowej produkcji małoseryjnej oraz do niskociśnieniowej obróbki plazmowej w laboratoriach badawczo-rozwojowych.